班号自动化与王学号190320.517 姓名 喜加 教师签字 预习成绩

一. 实验目的 1. 用"对称"测量法""测量UH-1H 曲线,计算霍尔元件是敏度 2.用"对称·测量法"测量 Un - 2m 曲线,计算霍尔元件 是敏度 二、实验原理 3、测量电磁铁气管中磁感应强度 B的 大小和为币 霍尔电压测量的副效应误差及其消除方法

(1) 电极不等势误差

电流14流过霍尔片时,垂直于14的平面称为等势面,如果测量 Un的两个电极不在同一个等势面就会存在一个附加电压。误差电压 Uo= Lir, Y为两电极电对应等势面间的电阻。Uo的方向取决于Lin, 与B无关,用对称测量法可以消除此误差。

(2)爱廷斯豪森效应

载流于的速度具有统计分布,霍尔电场 Ell 的人小取决于载流于的 平均速度 V,如果速度为 V 的载流于刚好平衡后,则速度大于和小于 V的载流于则会各自向对立面偏转。从而在Y各向产生温差并引起 温差电动势UE,其为向取决于山和B,因此不能用对称测量消除。 (3)里吉-勒迪克效应

如果在霍尔片X方向有温度梯度,则X为向云有一个扩散流ld。 其在Y方向将引起类似于多廷斯豪森效应的温差电动势Un, 其名句与B有关,但与117元光

(4) 能斯特效应

上述扩散流在洛伦兹加用下将直接产生附加电动势Un, 其方向与B有关,但与以无关。

UnaUn可以通过改变对方向用对称测量法消除。在非大电流 非强磁场下可忽略U已通过改变III和BS向可测得四下 霍尔电压值,将其绝对值求平均,就消防了副效应的误差。

```
三.数据处理
实验一: X4=24.65
                                                             对应的 fi= |xu-xp1=19.25 f= 12.06
                      XL1 = 25,20
                                                                               fo = 1 xu - x1 = 18.7
                        X4 = 24.65
                                                                              ts = | x23 - xp1= 19.25
                        XL4= 75.10
                                                                              fu = 1 xc4 - xpl= 18.8
                       XLS = 24.60
                                                                             fr = 1 x 14 - xp1 = 19.3
           A 美不确定度 Ux= J=1k-11 = 0、1279
           B美不确定度 Us: 0.05/15 = 0.0289
           总不确定度 U= JUx2+UB2 = 0.1311 E= Tx/00%= 0.69%
           f = \hat{f} \pm U = (19.1 \pm 0.2) cm E = 0.69% 置信概率P = 68.3%
买96二: 7=16.79 72=40.55 = 760+16.79-40.55=36.24
           L = 43.9 + 60 - 14.1 = 89.8 f = \frac{\tilde{L} - \tilde{L}}{47} = 18.7937
    成大像A类不确定度 U_{x,1} = \sqrt{\frac{270x_{x,1}^2}{1111}} = 0.0579
  成小像A美不确定度 U_{X2} = \sqrt{\frac{2.5 - 1)}{1.5 + 1.5 + 1}} = 0.0447 B美不确定度U_{g} = \frac{0.05}{15}
     U_{L} = \sqrt{U_{x_{1}}^{2} + U_{x_{2}}^{2} + U_{b}^{2}} = 0.0786 U_{L} = U_{B} = \frac{0.05}{\sqrt{1}}
      U_f = \sqrt{(\frac{1}{4})^2 U_{i}^2 + (\frac{1}{4})^2 U_{i}^2} = \sqrt{(-\frac{U}{2L})^2 U_{i}^2 + (\frac{1}{4}(1+\frac{U}{L})^2) U_{i}^2} = 0.0179
       E = \frac{U_f}{4} \times 10^{-9}\% = 0.10\% : f = \hat{f} \pm U = (18.79 \pm 0.02) cm E = 0.10\%
       置信概率P=68.3%
实验三: xi = = = 29.8 (主) XLI=49.0(主) XLI= = 51xLI= 56.2
 \chi_0'' = 15.0 \bar{u} = -(\chi_0'' - \bar{\chi}_{cc}) = 6.4 \bar{v} = +(\chi_0''' - \bar{\chi}_{cc}) = -21.2
   E= / (2/mt) U" + (2/mt) U" U" = 1/6 × 2/6× 2/6× 1/2 | U" = U8 + 2/6× 1/2
           · f=(9.17±0.02)cm E=0.16%=0.007
置信概率P=68.3%
                                                                                                                                                    = 0.0036
```

实验四: xin = 2978 X12 = 39.614 f= -(xin - xin)= = cm A美不确定度 Uxpz= \(\sigma_{\frac{1}{2}(\ho_1 - \bar{\kappa_1})}^2 = 0.0583 Uxuz = 1 = (xu-Xu)2 = 0.0812 B美不确定度 UB: 0.1040 E= = 1.06%

i. f= f1U = 986 + 0.1040 (9.86 + 0.15) cm

E=1.06% 置信概率 P=68.3%

此处应用。

四. 实验结论及现象分析

可以通过自准法,共轭法测量凸透镜焦距 可以通过物距-像距法和自准法测凹造镜焦距 用自准法现象为在挡板上会有创立的三个礼怡 好拼成一个圆,用共轭法可以看到像屏上的大像和小像, 物题一像距法也可以在像屏上看到小像和加入凹透镜后的大像 五. 讨论问题

卜用位物法(两次成像)测薄凸边镜焦距,为什么分须使物屏与 像屏距高大于4倍透镜焦距长度?

默认 U)0,U>0, f>0. ? は+ は= す 、f= 端v

- (u+v) -4uv = (u-v) = 0 : (u+v) > 4uv BP u+v > 4uv = 4f 了物配与像距之和大于4f,小于4f只能成一次像,无法测量焦距。
- 2. 从自准法测凸透镜的光路图可知物距,像距和焦距三者是相等的, 但这三个量显然不满足透镜成像,清解释原因. 因为加入了平面镜,导致光在行进过程中进行反射,再次递过 薄凸造镜得到等大倒立的像。所以云中于草不适合在

实验现多与原始数据记录 凸选镜位置 XL 实验qK 24.6 24.7 2 25.3 25.1 43.9 24.7 24.6 45 25.4 24.8 24.5 24.7 凸成小像 X2 凸选镜成大像位置X, 物位置 实验二 像屏位置 40.8 40.1 17.1 16.8 40.7 40.2 16.8 2 16.7 14.1 43.9 40.7 40.6 16.8 16.6 40.7 40.4 16.9 16.9 40.6 40.7 16.8 16.5 5 Χ°, Xº1 实验三 Xz XLI 36.1 29.7 36.3 2 9.8 15 2 49 36.2 29.9 3 36.3 29.6 4 36.1 29.9 5 χ_{2} 凸邊鏡位置 Xpz 实验四 39.7 29.7 39.5 29.8 7 39.8 49 29.9 39.4 29.6 39.8 29.9

教师签字:宇南岛